INTERNATIONAL STANDARD

ISO 17109

Second edition 2022-03

Surface chemical analysis — Depth profiling — Method for sputter rate determination in X-ray photoelectron spectroscopy, Auger electron spectroscopy and secondary-ion mass spectrometry sputter depth profiling using single and multi-layer thin films

Analyse chimique des surfaces — Profilage d'épaisseur — Méthode pour la détermination de la vitesse de pulvérisation lors du profilage d'épaisseur par pulvérisation en spectroscopie de photoélectrons par rayons X, spectroscopie d'électrons Auger et spectrométrie de masse des ions secondaires à l'aide de films minces multicouches



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation 4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage

Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn